

International Workshop of Ultra High-Resolution on Microscopy 2019 電子波による電磁場観察はどこまで高分解能化できるのだろうか

開催日：2019年2月22日(金), 23日(土) 定員：50名 申込み期限：12月28日
会場：日立基礎研究センタ コンファレンスルーム (定員に達し次第締切り)

2月22日 (金)

- 11:45- 【基調講演】 平山司 (JFCC)
「電子波干渉による電場・磁場の観察 ～その進歩と将来～」 (日本語)
- 12:45- ランチ
- 13:30- R.E. Dunin-Borkowski (Research Center Jülich)
“Quantitative Atomic Observation by Electron Holography”
- 14:15- D. Cooper (Univ. Grenoble)
“Field Mapping of Semiconductor Material by Off-Axis Electron Holography, Differential Phase Contrast and 4D STEM”
- 15:15- 村上 恭和 (九大)
“High-Sensitive Phase Measurement in Materials Science”
- 15:45- 柴田 直哉 (東大)
“Towards Subatomic-Resolution Electron Microscopy:
Can We Observe Inside of Atoms?”
- 16:15- 谷垣 俊明 (日立)
“Towards Imaging of Magnetic Field at Atomic Level”
- 17:00- ポスターセッション&ラボツアー、バンケット

2月23日 (土)

- 9:00- A. Blackburn (Univ. Victoria)
“Experimental Assessment of High-Speed, Low Dose Ptychography”
- 9:30- 佐川 隆亮 (日本電子)
“Applications for Electron Ptychography using Fast Pixelated STEM Detector”
- 10:00- 山崎 順 (阪大)
“Advances in Diffractive Imaging”
- 10:50- 佐々木 宏和 (古河電工)
“Analysis of Electrostatic Potentials in Compound Semiconductors and Laser Dose
~Utilization of Several Techniques in Electron Phase Imaging~”
- 11:20- 柴田 基洋 (理研)
“Structure and Behavior of Magnetic Skyrmions:
~Magnetic Imaging by Electron Holography and Lorentz TEM~”



会費：

会員	(Full 15,000円、1日 4,000円、1日+バンケット 8,000円)
学生	(Full 12,000円、1日 1,000円、1日+バンケット 5,000円)
非会員	(Full 20,000円、1日 9,000円、1日+バンケット 13,000円)
(Fullは、会議費、バンケット、宿泊代などを含む。)	

ポスター発表を募集します。

研究会なので「測定方法について相談したい」などでも構いません。
ポスター申込み、参加申し込み、問い合わせ等は、下記eメールにて受け付けます。
phase2019@jaist.ac.jp

会場アクセス



住所：〒350-0395 埼玉県比企郡鳩山町赤沼2520番地
TEL：049-296-6111 (代表)

責任者 大島 義文 (JAIST) email: oshima@jaist.ac.jp
谷垣 俊明 (日立 基礎研究センタ) email: toshiaki.tanigaki.mv@hitachi.com

日本顕微鏡学会 超高分解能顕微鏡法分科会
文部科学省先端研究基盤共用促進事業 アトミックススケール電磁場解析プラットフォーム